無電解Fe-Ni-B合金めっき皮膜の熱応力挙動

表面処理チーム 山本 貴代,永山 富男,中村 俊博

要 旨

無電解めっき法を用いて鉄-ニッケル-ホウ素(以下, Fe-Ni-B) 合金薄膜を作製し,成膜時の応力発生,熱応力挙動 を評価し,合金組成及び微細組織と関連付けた。成膜応力は,Feを含まない膜からインバー組成領域の間において, 3つの領域に分けることができ,低Fe含有率(Fe:0~10 wt%,B:4~5 wt%)のめっき膜では約100 MPa~200 MPa の低応力値,中Fe含有率(Fe:20~40 wt%,B:1~2 wt%)では約800 MPaの高応力値,高Fe含有率のインバー組成 である(Fe:55~63 wt%,Bはいずれも0.3 wt%以下)めっき膜では約500 MPaの中応力値を示した。熱応力挙動は, 低Fe含有率のめっき膜において,加熱による相分離,あるいは相分離前に生じる回復によって,膜が収縮し,300 ℃ までの加熱・冷却後に応力が劇的に増大した。膜中のFe含有率の増大に付随してB含有率の低下が進むに伴い,これ らの加熱による収縮はほとんど認められなくなった。さらに,高Fe含有率のインバー組成膜では,CTE値が小さいこ とから,加熱・冷却時の熱応力変化及び再室温時の応力値が種々の合金比率のFe-Ni-B膜中で最も低い値を示した。こ れらの成膜応力や熱応力挙動は,膜の合金組成及び微細組織と密接に関連した。

1. はじめに

超スマート社会の実現に向けて,電子デバイス用の高 密度パッケージングのより高い信頼性が検討されてい る。現在,電子デバイスの高密度パッケージにおいて は、めっき法による薄膜形成技術が不可欠である。特に, ニッケル (Ni) 及びNiを主成分とする金属薄膜は,その 電気的特性,化学的特性,及び機械的特性が優れている ために,多用されてきた。しかしながら,将来要求され るより高い実装信頼性を得るためには,既存材料に代わ る新たな薄膜材料の探索が必要となる¹⁻³⁾。

鉄-ニッケル (Fe-Ni) 合金薄膜は、Ni 薄膜と比較して、 鉛フリーはんだとの優れた濡れ性と低い反応速度(食わ れ抑制)を示すため、有望視されている¹⁾。さらに、「イ ンバー合金」と呼ばれる、鉄含有量が55~70 wt%の高 温冶金で製造されたFe-Ni 合金は、熱膨張係数(CTE) が半導体に近い、低い値を示す⁴⁾ため研究者の興味を惹 いている^{1.5-6)}。

特に,無電解Fe-Ni合金めっきプロセスは,絶縁基板 などの非導電性材料上に金属化された膜を形成すること を可能にするため,現在関心が持たれている。

しかし、無電解めっき法でFe-Ni合金薄膜を作製する 場合、FeとNiイオンの還元の電位差、あるいはFe²⁺の 酸化のしやすさから、目的のFe/Ni合金比率の膜を得る ことは容易ではない¹⁾。そのため、高密度半導体実装へ の適合性にかかわる無電解めっきで作製したFe-Ni合金 膜の熱膨張特性は十分に研究されていない。 我々はこれまでに、FeとNiイオンの還元の電位差を 低減し、無電解めっき法を用いてインバー組成のFe-Ni-B合金薄膜を作製し、Ni-B合金膜と比較して、それ らの熱応力挙動を評価した⁷⁻⁸⁾。300 ℃加熱におけるSi 基板上の無電解Ni-Bめっき膜とインバーめっき膜の熱 応力を評価した結果、無電解インバーめっき膜におい ては、Niを主成分とするめっき膜に比べ熱応力が軽減 できることを示した⁸⁾。めっき膜の熱応力挙動は、膜の CTEと加熱による結晶構造の変化に関連していること が示された。

さらに、これまでの検討結果⁷⁻⁸⁾から、無電解インバー めっき膜をデバイスに適応する場合には、加熱時の熱応 力挙動に加えて、初期の成膜時の応力もデバイスの信頼 性を決定する因子になることが示唆された。

しかしながら,無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の成膜応 力とその加熱による変化,すなわち熱応力について,系 統的な検討はこれまで行われていない。

本研究では、無電解めっき法で作製されたFe-Ni-B合 金薄膜の成膜時の応力や熱応力挙動をより詳細に調査す るため、前報⁸⁾に加えて、Fe含有量が0~63 wt%まで の幅広い無電解Fe-Ni-B合金膜を作製し、それらの応力 発生、熱応力を結晶構造や粒径と関連付けて検討した。

2. 実験方法

2.1 無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の作製

無電解Fe-Ni-B合金めっき皮膜を作製するために、表

表1 めっき浴組成及びめっき条件8)

硫酸鉄7水和物	0-0.02 mol/L	
硫酸ニッケル6水和物	0.03-0.05 mol/L	
ジメチルアミンボラン	0.025 mol/L	
くえん酸カリウム	0.1 mol/L	
ピロりん酸カリウム	0.005 mol/L	
浴温度	70°C	
pН	10.0	

1に示しためっき浴とめっき条件を用いた⁸⁾。使用した 試薬は、富士フィルム和光純薬製のケミカルグレード 品とナカライテスク製である。基板には、直径4inchSi, 厚さ525 µmのウェハに、Cr次いでNiスパッタを約 10 nmずつ施したものを用いた。Zhouら¹⁾の結果を参 照して、アルミニウムシートを基板に接触させ析出を 促した。全金属イオン濃度は0.05 mol/Lであり、Fe²⁺/ (Fe²⁺+Ni²⁺)の比率は0から0.4まで変化させた。浴温 は70 ℃、pHは10.0とし、めっき時間はめっき厚さが 500 nmとなるよう調整した。

2.2 Fe-Ni-B合金めっき膜の物性評価

得られた合金めっき膜の組成は、電子線マイクロアナ ライザ(以下, EPMA,日本電子製 JXA-8230)を用いて (加速電圧15 kV, ビーム直径20 µm), ZAF法により 決定した。めっき膜厚さは蛍光X線-FP法(日立ハイテ クサイエンス製 SEA6000VX)により決定した。これら の標準試料には、高純度化学製溶製Fe-Ni合金を用いた。 表面形態の観察には走査型電子顕微鏡(以下, FE-SEM, 日本電子製 JSM-6700F)を用いた。めっき皮膜の粒径 は、観察される平均粒径から算出した。

めっき膜の熱応力挙動を評価するために,薄膜応力計 (東朋テクノロジー製 FLX-2320S)を用いた。試料の 曲率Rを30 ℃~300 ℃まで,昇温速度1℃/min, N2雰 囲気 (500 mL/min) において測定した。

得られた曲率*R*をストーニーの式(1)⁹⁾を用いて膜の応力値 σとして算出した。

$$\sigma = \frac{E_s t_s^2}{6(1 - v_s)Rt_F} \tag{1}$$

ここで、 σ は無電解めっき膜及び中間層であるスパッ 夕膜の合計の応力、Esは基板のヤング率、tsは基板Si の厚さ、trは無電解めっき膜及び中間層であるスパッタ 膜の合計の厚さ、vsは基板のポアソン比、Rは曲率であ る。Es/(1-vs)は基板の二軸弾性係数である。基板Si の二軸弾性係数は180.5 GPa¹⁰⁾を用いた。

また,求められた応力より,中間層のNi及びCrスパッ 夕膜の応力 σ_{int} については以下の(2)式¹¹⁾より差し引 き,以下の式(3)より無電解Ni-B及び無電解Fe-Ni-B 合金めっき膜のCTE α FeNiを算出した。

$$\sigma_{film} = \frac{1}{t_{film}} \left[\sigma_{\text{total}} (t_{int} + t_{film}) - \sigma_{int} t_{int} \right] \quad (2)$$
$$\frac{\Delta \sigma_{film}}{\Delta T} = \frac{E_{film} (\alpha_{film} - \alpha_S)}{1 - \nu_{film}} \quad (3)$$

ここで、 σ_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき 膜の応力、 σ_{total} はめっき膜及びスパッタ膜の応力(前 述(1)式の σ と同義)、 σ_{int} は中間層であるNi及びCr スパッタ層の応力、 t_{int} は中間層であるNi及びCrの厚さ、 t_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき膜の厚さ、 α film は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき膜の線膨張係 数、 α_s は基板Siの線膨張係数(3.2 ppm/K¹²⁾)、 v_{film} は 無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアソン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアソン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアソン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアソン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアソン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、 E_{film} は無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアリン比、

3. 結果

3.1 無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の形成時及び加熱時の 応力

めっき浴中のFe²⁺/(Fe²⁺+Ni²⁺)比と応力測定に用いた 無電解めっき膜の合金組成を表2に示す。

Ni/Cr/Si基板上においてFe含有率0 wt %~63 wt % のFe-Ni-B合金めっき膜が得られた。Bは還元剤のジメ チルアミンボランからの共析である。Fe含有率の増大 に伴い、Bの含有率は減少した。

無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の30 ℃から300 ℃まで

表 2 Fe²⁺/(Fe²⁺+Ni²⁺)比と応力測定に用いた無電解めっき膜 の合金組成

Fe ²⁺ / (Fe ²⁺ +Ni ²⁺) 比	Fe 含有率 /wt %	Ni 含有率 /wt %	B 含有率 /wt%
0	0	95	5
0.05	11	85	4
0.1	19	79	2
0.2	37	62	1
0.3	55	45	< 0.3
0.4	63	37	< 0.3

京都市産業技術研究所





 図 2 めっきしたまま(○),300℃加熱後の再室温(30℃)
 (□)における膜の応力 σ_{film},及び加熱・冷却中の最 大応力値及び最小応力値の差Δσ_{film}(△)に及ぼすFe 含有率の影響

の σ_{film} を測定し、これらの結果から膜の熱膨張挙動を 調べた。

図1に、30 ℃から300 ℃に加熱し、300 ℃から 30 ℃に冷却した間に得られた無電解Fe-Ni-B合金めっ き膜の σ_{film} を示す。併せて300 ℃から室温(30 ℃) へ の冷却間のCTE値を熱応力曲線の傾きから算出し、図 中右上にそれぞれ示す。図2には、図1より算出した、 めっきしたまま、300 ℃加熱後の再室温(30 ℃)にお ける膜の応力 σ_{film} 、及び加熱・冷却中の最大応力値及 び最小応力値の差 $\Delta \sigma_{film}$ を示す。

図2より、成膜応力は、Fe含有率に応じて、3つの

領域に分類できることが分かる。低Fe含有率領域であるFe含有率0 wt%~10 wt%の無電解Ni-Fe-B合金膜の σ_{film} は、約100 MPa~200 MPaの低い引張応力であった。次に、中Fe含有率であるFe含有率20 wt%~40 wt%の場合、 σ_{film} は約800 MPaまで著しく増加し、高い引張応力を示した。高Fe含有率のインバー組成範囲であるFe含有率55 wt%~63 wt%の膜では、 σ_{film} は減少し、約500 MPaの中程度の引張応力を示した。

図1に示すように、Feを含まないNi-5 wt % B合 金めっき膜の σ_{film} は、260 ℃から270 ℃まで間に-200 MPaから200 MPaまで著しく増加した。これは Ni-5 wt % B合金めっき膜の急激な収縮が、この温度 範囲で生じたことを示唆している。この非可逆的な収 縮に加えて、300 ℃から30 ℃の冷却間のCTE値が約 14 ppm/Kと大きいため、再び室温に戻る際に σ_{film} は 1000 MPaにまで増大した。図2に示すように、加熱・ 冷却中の熱応力変化の差 $\Delta\sigma_{film}$ も、膜収縮及び高CTE 値に起因して、Ni-B合金膜が最も大きな値1200 MPaを 示した。

無電解 Fe-85 wt % Ni-4 wt % B合金めっき膜の 200 ℃から300 ℃までの σ filmは, -65 MPaの一定値を 示し,温度変化による熱応力の変化は見られなかった。 すなわち,Ni-5 wt % B膜のような急激な収縮は認めら れないが,膜の格子振動による熱膨張を打ち消す程度の 収縮が生じていることが示唆される。この収縮も非可逆 的であり,またNi-5 wt % B膜と同様に高いCTE 値を示 すことから、再び室温に戻る際に σ_{film} は約800 MPa に まで増大した。

対照的に、Fe含有率が約20 wt%を超える中Fe含有 率及び高Fe含有率の膜の σ_{film} は、30 ℃から300 ℃に 加熱した後、さらに30 ℃に冷却すると、ほぼ直線的に 減少及び増加し、それぞれ膜の格子振動による熱膨張・ 収縮に由来するCTE値に依存した可逆的な熱応力挙動 を示すことが判明した。しかし、中Fe含有率の膜にお いては、成膜応力が高いため、一連の加熱・冷却時に高 応力値を推移する。他方、インバー組成である高Fe含 有率Fe-Ni-B膜は、その成膜応力が中程度であり、さら に約10 ppm/Kの低CTE値を有することから $\Delta \sigma_{film}$ が最 も小さく、加熱・冷却時も安定した比較的低い σ_{film} を 示すことが判明した。

Fe含有率63 wt%以外のFe-Ni-B合金めっき膜は,同 じFe/Ni合金比率を有する溶製Fe-Ni合金のCTE¹³⁾とほ ぼ同じであった。Fe含有量が63 wt%のFe-Ni-B合金の CTEは約10 ppm/Kであり,同Fe/Ni比の溶製合金より 大きなCTEを示し,電気インバー合金めっき皮膜と同 等の値であった¹⁴⁻¹⁵⁾。この要因については,後に示す準 安定相であるbcc相を膜の結晶構造として含むためであ るが,詳細は前報⁸⁾に述べたため,そちらを参照された い。いずれのCTE値もBの影響は認められなかった。

以上の結果から,無電解Fe-Ni-B合金めっき膜は,成 膜応力,加熱による非可逆的な膜収縮,CTE値に依存 する熱応力挙動を示すことが判明した。特に,インバー 組成の膜は,加熱・冷却時の熱応力変化が少なく,その 絶対値も小さいことから,耐熱性メタライズ膜として有 用であることが示唆された。

3.2 無電解Fe-Ni-Bめっき膜の結晶構造及び表面形態

得られた無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の成膜応力,及び熱応力に及ぼす合金組成及び加熱・冷却の影響を調べるために,膜の結晶構造及び表面形態を評価した。

図3に、めっきしたまま及び300 ℃までの応力測定 後のFe含有量が0 wt %から63 wt %の無電解めっき Fe-Ni-B合金薄膜のXRDパターンを示す。図4には同 様にめっきしたまま及び300 ℃までの応力測定後の表 面形態を示す。

低Fe含有率領域のNi-5 wt % B及びFe-85 wt % Ni-4 wt%Bの無電解めっき膜の約44°のXRDピークは、 ブロードな回折パターンを示した。文献¹⁶⁻¹⁷⁾ によれば, B含有量が4 wt%以下の無電解Ni-B合金膜は超微細結



晶を示し,B含有量が4 wt%を超えると非晶質となる。 得られたNi-5 wt%B膜は,先の研究¹⁶⁻¹⁷⁾と図3に示す XRDパターンから非晶質であると推定された。Fe含有 率が20 wt%から55 wt%までのFe-Ni-B合金めっき膜 の回折パターンには,熱平衡相である面心立方(fcc)相¹³⁾ に由来する明確な回折ピーク観察された。Fe含有率の 増大に伴って,半値幅は減少し,より高い結晶化度の膜 が得られた。Fe含有量63 wt%のFe-Ni-B合金めっき膜 では,fcc (111)面のピークとともに44°付近の高角側に 体心立方bcc (110)面のピークが検出された。溶製Fe-36 wt%Ni合金で観察されたfcc単相¹³⁾とは異なるbcc とfccの混合相であった。インバー組成において,電気 めっき法や無電解めっき法で作製されたFe-Ni合金めっ き膜は,インバー組成領域において,しばしば水素発生

京都市産業技術研究所



図4 種々Fe含有率の無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の表面形態

や水素化物発生に伴う準安定相であるbcc相が出現し, fcc相との2相混相であることが報告されている^{1,15,18)}。 したがって、本研究で得られた膜も同様に混相が観察さ れたと考えられる。 図4からは、めっきしたままの膜は、Fe含有率が増 大するに伴って、表面形態から推察される粒径は増大す ることが示された。

300 ℃に加熱によって, 無電解Ni-5 wt%B合金めっ き膜のXRDパターンに明確なピークが現れ, それらは NiとNi₃Bに帰属された。約44°でのfcc (111) ピークの 半値幅は, めっきしたままの膜の約7°から, 300 ℃に 加熱した後,約0.2°まで減少した。

Feを含有したいずれのFe-Ni-B膜においても,300 ℃ に加熱した後,結晶相ピークの半値幅のわずかな減少及 び約43°でのfcc相のピーク高さの増加が観察されたのみ であり,相分離や相変態,再結晶を伴う急激な半値幅の 減少は認められなかった。

図4の表面形態観察からは、300 ℃に加熱した後の膜 表面のわずかな酸化が観察されたが、めっきしたままの 表面形態と非常に類似し、クラックや著しい結晶粒の増 大は観察されなかった。

4. 考察

無電解及び電気めっき膜の膜形成によって発生する応 力は,組成に依存した微細組織に関連することがこれま で多く報告されている。

今回のようなNiに対し、原子半径の大きく異なるB 及びリン(P)の含有量が多く、非晶質膜が得られた場 合には、析出時に粒界が認められず、原子の再配列が生 じないため、引張応力または圧縮応力の値が減少するこ とが知られている¹⁹⁾。例えば、Linら²⁰⁾は、電気Ni-P合 金めっき膜において、非晶質相が得られるP含有率(約 7 wt%)では、ほとんど0MPaに近い応力であるが、 約2 wt%のP含有率では、得られる膜は極微細結晶で あり、極めて高い約600MPaの応力を示し、純Ni膜で は粒径の増大とともに、約150MPaにまで再び減少す ることを報告している。

したがって、本研究では、図3及び4で観察されたように、低Fe領域のめっきしたままのFe-Ni-B合金膜は、 B含有率が高く、ほとんど準安定相のアモルファス状態であるため、低い成膜応力を示したと考えられる。

他方,Vicenzo²¹⁾は,結晶性の電気Fe-Ni合金めっき 膜では,Niと原子半径の近いFeの含有率が高いほど, 粒径が微細化し,欠陥密度が高くなり,その結果,膜形 成時の応力が大きくなると報告している。

本研究では、中Fe含有率領域のFe含有率19 wt%及 び37 wt%の無電解めっきFe-Ni-B合金膜は、結晶性で はあるものの,高Fe含有率膜に比べ,多くのBを含む ため,非常に微細な結晶を有する膜であった。そのため, 膜中の欠陥が増大し,高Fe含有率領域の膜に比べ,高 い引張応力値を示したと考えられる。さらに,高Fe含 有率領域のFe含有量が55 wt%及び63 wt%のインバー 組成のFe-Ni-B合金めっき膜は,B含有率が極めて微量 であるため,結晶性が高く,結晶粒径が大きいため,応 力が再び低下したと考えられる。しかし,Vicenzo²¹⁾の 報告のように,高Fe含有率膜のため,Linら²⁰⁾が報告し た純Ni 膜ほど成膜応力は低下しなかった。

これらの膜を加熱すると、Ni-B膜は、前報⁸⁾でも述べ たように、準安定相であるアモルファスNi-B膜がNiと Ni₃Bへと相分離を生じたため、260 ℃から270 ℃にお いて収縮が生じたと考えられる。Fe-85 wt%Ni-4 wt% B合金膜についても、Songら²²⁾が無電解Ni-P合金めっ き膜で報告しているように、相分離前の回復が生じてい る可能性によって、膜収縮が生じたと示唆される。一方、 中Fe含有率及び高Fe含有率の膜は、めっきしたままと 加熱後も、結晶構造や粒径などに変化が認められないた め、加熱・冷却時に可逆的な熱応力挙動を示したと考え られる。

以上の結果から,低Fe含有率の膜では,準安定相で あるアモルファス相を有するため,成膜応力が低いもの の,加熱による熱平衡相への相分離あるいはその前段階 の回復によって,非可逆的な膜の収縮が生じることが 示された。さらに,300 ℃加熱後から30 ℃冷却までの CTE値は,その合金比率の典型的な約14 ppm/Kと大き な値を示した。これらの要因によって,加熱・冷却中も 応力変化が大きく,再び室温状態に戻る際には,著しく 高い引張応力を示した。

中Fe含有率の膜では、低いB含有率に影響され、微細な粒を有するため、成膜応力は最も高く、成膜時に熱 平衡相であるfcc相が得られるため、加熱・冷却時の変 化は可逆的であった。したがって、熱応力挙動は、成膜 応力値が支配的となる高応力下で変化した。

インバー組成である高Fe含有率の膜では、ほとんど Bを含有しないため、他のFe含有率の膜に比べ、粒径 は大きく、それにより成膜応力は中程度を示した。Fe 含有率63 wt%の膜は、準安定相のbcc相を含むが、 300 ℃までの加熱によるfcc熱平衡相への相変態は観察 されないため、熱応力変化は可逆的であった。さらに、 CTE 値が他のFe含有率の膜と比べ低いため、加熱・冷 却中そして再室温時においても熱応力変化は小さく、成 膜応力付近の約500 MPaの応力を常に示すことが判明 した。

以上の結果から,無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の熱応 力挙動は,膜中の還元剤由来のB含有率に依存した成膜 時の粒径及び微細構造が支配的な要因となる成膜応力 値,加熱による熱平衡相への変化の有無,及びFe/Ni合 金比率及び微細構造に決定づけられるCTE値に起因し て変化することが示唆された。

今回得られた無電解Fe-Ni-B合金めっき膜は、Fe及び Bの合金化によって非常に微細な粒から成るため、その 程度を観察するため、今後は、透過型電子顕微鏡を活用 し、より詳細な評価を行う予定である。

5. 結 論

無電解めっき法を用いて種々の合金比率のFe-Ni-B合 金薄膜を作製し、その熱応力挙動や結晶構造及び表面形 態を評価した結果、以下のことが判明した。

- ・成膜応力は、Feを含まない膜からインバー組成領域の間において、3つの領域に分けることができ、低Fe含有率では低応力値、中Fe含有率では高応力値、高Fe含有率では中応力値を示した。
- ・無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の熱応力挙動は,Fe含有 率の増大に伴うB含有率の低下が進むに従い,加熱に よる収縮はほとんど認められなかった。
- ・熱応力挙動は、CTE値、合金比率に由来する微細組 織とその加熱による変化に依存することが示唆され た。

無電解インバーFe-Ni-B合金めっき膜は、成膜応力が 中程度ではあるものの、半導体チップあるいは基板との CTEマッチングにより、加熱・冷却時の熱応力変化及 び再室温時の応力値が種々の合金比率のFe-Ni-B膜中で 最も低いことから、デバイスの熱応力の低減効果につい て期待できる。

謝 辞

本研究で使用した,薄膜ストレス測定装置 FLX2320-S は平成27年度にJKA補助金を受けて設置したもので付 記して謝意を表します。

本研究のヤング率の測定には(株) エリオニクス超微 小押し込み硬さ試験機(ENT-2100)を使用させて頂きま した。ご協力頂きました(株) エリオニクスの関係各位 に感謝申し上げます。

参考文献

- H. Zhou, J. Guo, and J. Shang, J. Electrochem. Soc., 160, D233 (2013).
- X. Hu, S. Xu, Y. Yang, Z. Chen, and Y. C. Chan, *Mater. sci. eng. A*, 600, 67, (2014).
- H. Zhou, J. Guo, J. Shang, and X. Song, J. Alloy. Comp., 818, 152900. (2020).
- 4) C. E. Guillaume, CRAcad. Sci., 125, 235 (1897).
- L. Y. Gao, C. F. Li, P. Wan, H. Zhang, and Z. Q. Liu, J. Alloy. Compd., 739, 632, (2018).
- 6) Y. W. Yen, Y. P. Hsieh, C. C. Jao, C. W. Chiu, and Y. S. Li, *J. Electron. Mater.* 43, 187, (2014).
- T. Yamamoto, T. Nagayama, and T. Nakamura, J. Electrochem. Soc. 166, D3238 (2019).
- 8) 山本貴代, 永山富男, 紺野祥岐, 中村俊博, 京都市 産業技術研究所研究報告 No. 7, 12, (2019).
- 9) G. Stoney, Proc. R. Soc. London A, 82172 (1909).
- 10) W. A. Brantley, J. Appl. Phys., 44534 (1973).
- 11) L. B. Freund, and S. Suresh, *Thin Film Materials Stress, Defect Formationand Surface Evolution*, p. 137, Cambridge University Press (2004).
- 12) P. J. Burkhardt, and R. F. Marvel, J. Electrochem. Soc., 116, 864 (1969).
- 13) H. Masumoto, Sci. Rep. Tohoku Imp. Univ., 20, 101 (1931).
- T. Nagayama, Y. Mizutani, T. Nakamura and N. Shinohara, J. Surf. Sci. Soc. Jpn., 57, 733, (2006) (inJapanese).
- 15) T. Nagayama, T. Yamamoto, and T. Nakamura, *Electrochim. Acta*, **205**, 178 (2016).
- M. Crobu, A. Scorciapino, B. Elsener, and A. Rossi, *Electrochim. Acta*, 53 (8), 3364 (2008).
- 17) T. Watanabe and Y. Tanabe, *Trans. Jpn. Inst. Met.*, 24 (6), 396 (1983).
- 18) R. Anthony, B. J. Shanahan, F. Waldron, C.
 Ó. Mathúna, and J. F. Rohan, *Appl. Surf. Sci.*, 357, 385 (2015).
- 19) G. O. Mallory, Plat. and Surf. Fin., 67, 86 (1985).
- 20) C. S. Lin, C. Y. Lee, F. J. Chen, and W. C. Li, J. Electrochem. Soc., 152, C370 (2005).
- 21) A. Vicenzo, J. Electrochem. Soc., 160, D570 (2013).
- 22) J. Y. Song and J. Yu, Thin Solid Films, 415, 167 (2002).